

平成29年度 Nanotech CUPAL N.I.P.コース (予定)

H29.7.24

コース番号	コース名	定員	実施型	実施期間	一般受講料		
					学生	その他	
産業技術総合研究所					学生	その他	
FY2017_AI001	TCAD実習初級 (+中級) コース	10	《短期型》	1回/年(7月19日~21日)	¥5,000	¥5,000	
FY2017_AI002	SCR 超微細加工プロセスコース	3	《短期型》	2回/年	¥180,000	¥180,000	
FY2017_AI003	MEMS 2週間コース	5	《短期型》	随時	¥200,000	¥250,000	
FY2017_AI004	TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール	10	《短期型》	8月26日~8月29日	¥0	お問い合わせ下さい	
FY2017_AI005	MEMS 5日間コース	8	《短期型》	2回/年(10月、12月)	¥100,000	¥150,000	
FY2017_AI006	透過型電子顕微鏡による高分子試料解析技術入門コース	10	《短期型》	2回/年(8月、11月)	¥50,000	¥50,000	
FY2017_AI007	先端量子 (X線・陽電子) ビーム分析法	3	《短期型》	1回/年(12月)	¥0	¥0	
FY2017_AI008	光周波数計測技術「入門」コース	3	《短期型》	1回/年(11月)	¥0	¥0	
FY2017_AI009_A	糖鎖プロファイリング初級コース	5	《短期型》	2回/年(5月、10月)	¥0	¥20,000	
FY2017_AI009_B	TIAナノバイオサマースクール (糖鎖・レクチン)	20	《短期型》	1回/年 (9月7日、8日)	¥0	¥0	
物質・材料研究機構					学生	大学等研究者	その他
—	先端計測技術入門コース (TEM)		《短期型》	4回/年	¥10,000	¥20,000	¥40,000
FY2017_NI001_A	FIBによる断面試料作製	10		5月10日~12日			
FY2017_NI001_B	イオンミリングによる断面試料作製	10		7月19日~21日			
FY2017_NI001_C	TEM操作の基本	10		10月25日~27日			
FY2017_NI001_D	TEM/STEM・EELSの基礎	10		1月24日~26日			
—	先端計測技術上級コース (TEM)	6	《中長期・分散型》	2回/年	¥50,000	¥100,000	¥200,000
FY2017_NI002_A	TEM/STEM観察・分析技術			(中期・後期)			
FY2017_NI002_B	収差補正TEM/STEM技術						
FY2017_NI002_C	STEM-EDS/EELS分析技術						
—	先端計測技術入門コース (表面解析)	36	《短期型》	4回/年	¥10,000	¥20,000	¥40,000
FY2017_NI003_A	超高真空走査型トンネル顕微鏡の初歩						
FY2017_NI003_B	表面分析の初歩						
FY2017_NI003_C	走査型ヘリウムイオン顕微鏡の初歩						
—	先端計測技術上級コース (表面解析)	6	《中長期・分散型》	2回/年	¥50,000	¥100,000	¥200,000
FY2017_NI004_A	極高真空低温SPM法			(中期・後期)			
FY2017_NI004_B	表面解析PEEM/MEEM法						
FY2017_NI004_C	Heイオン顕微鏡						

平成29年度 Nanotech CUPAL N.I.P.コース (予定)

H29.7.24

コース番号	コース名	定員	実施型	実施期間	一般受講料		
—	先端計測技術入門コース (構造解析)	60	《短期型》	4回/年	¥10,000	¥20,000	¥40,000
FY2017_NI005_A	X線・中性子粉末構造解析法の初歩						
FY2017_NI005_B	小角X線散乱計測法の初歩						
FY2017_NI005_C	X線反射率法の初歩						
FY2017_NI005_D	核磁気共鳴実験の初歩						
—	先端計測技術上級コース (構造解析)	8	《中長期・分散型》	2回/年 (中期・後期)	¥50,000	¥100,000	¥200,000
FY2017_NI006_A	粉末回折法						
FY2017_NI006_B	小角/極小角X線散乱法						
FY2017_NI006_D	薄膜・多層膜X線反射率法						
FY2017_NI006_C	固体NMR計測法						
高エネルギー加速器研究機構					大学・公的研究機関		その他
FY2017_KE001	放射光利用技術入門コース	各10	《短期型》	2回/年 (4-5月、11-12月)	¥0 お問合せ下さい		
FY2017_KE002	放射光分析技術上級コース	3	《中長期・分散型》	随時	¥0		
筑波大学					学生	その他	
—	放射線計測実習コース	2~4	《短期型》	2回/年 (8月下旬~9月上旬、2月下旬~3月上旬)	¥0	¥0	
FY2017_TU001_A	陽電子消滅コース						
FY2017_TU001_B	メスバウアー分光コース						
—	高機能ナノ微細加工実習コース	3~5	《短期型》	2回/年 (8月30日~9月1日、2月下旬~3月上旬)	¥0	¥50,000	
FY2017_TU002_A	MOSキャパシタの作製と電気特性評価コース						
FY2017_TU002_B	FIB技術実践コース						
FY2017_TU002_C	EB描画による微細パターン形成実習コース						
FY2017_TU002_D	μTAS実習コース						
—	加速器・イオンビーム分析実習コース	2~4	《短期型》	2回/年 (8月下旬~9月上旬、2月上旬~3月上旬)	¥0	¥0	
FY2017_TU003_A	加速器質量分析AMSコース						
FY2017_TU003_B	表面分析RBS/ERDAコース						
FY2017_TU003_C	軽・重元素分析 (PIXE、NRA) コース						
FY2017_TU004	ナノエレクトロニクス・ナノテクノロジーサマースクール	※5	《短期型》	1回/年 (8月29日~9月1日)	¥0	¥0	
FY2017_TU005	ナノグリーン・サマースクール	※5	《短期型》	1回/年 (8月29日~31日)	¥0	¥0	
FY2017_TU006	先端計測・分析サマースクール	※5	《短期型》	1回/年 (8月28日~30日)	¥0	¥0	
FY2017_TU007	サマーレクチャー	各科目※5	《短期型》	1回/年 (7月24日~8月3日)	¥0	¥0	

平成29年度 Nanotech CUPAL N.I.P.コース（予定）

H29.7.24

コース番号	コース名	定員	実施型	実施期間	一般受講料
京都大学					
FY2017_KY001	電子線描画装置入門コース	3	《短期型》	1回/年(8月)	¥250,000
FY2017_KY002	電子線描画装置アドバンスコース	3	《短期型》	1回/年(3月)	¥250,000
FY2017_KY003	MEMSコース	各期3	《中長期・分散型+集中型》	前期・後期	¥1,000,000
FY2017_KY004	マイクロ・ナノスケール材料工学コース	3	《短期型》	1回/年(9月)	¥296,000
FY2017_KY006	圧電デバイスコース	3	《短期型》	1回/年(10月)	¥250,000
FY2017_KY007	フォトニックコース	3	《短期型》	1回/年(12月)	¥250,000

※ Nanotech CUPALの補助対象者の募集人数は5名。一般参加を含む募集人数は30名（サマレクチャーは各科目30名）